

蛍光X線膜厚計

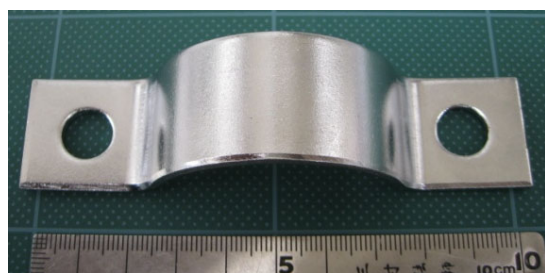
■機器の概要

試料にX線を照射し、めっきから放射される蛍光X線量を測定して、最小直径0.1mmの微小領域のめっき厚を非破壊で測定することができます。（JIS H 8501 めっきの厚さ試験方法）

■活用事例の活用

活用例① 多層めっきのめっき厚の測定

● 鉄上のニッケル-クロムめっき

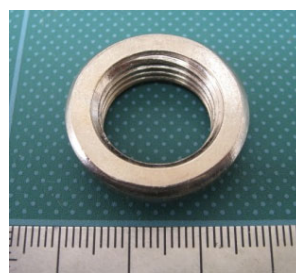


	Crめっき厚	Niめっき厚
平均値	0.385 μm	17.8 μm
標準偏差	0.003 μm	0.060 μm
C.O.V. (%)	0.66	0.34
測定数	6	6
最小値	0.38 μm	17.8 μm
最大値	0.39 μm	18.0 μm
測定秒数	20 sec	

* コリメーターサイズ： $\phi 0.3\text{mm}$

活用例② 合金めっきのめっき厚と組成の測定

● 鉄上のニッケル-リン合金めっき



	Ni-Pめっき厚	P含有量	Ni含有量
平均値	7.52 μm	10.20%	89.80%
標準偏差	0.400 μm	0.59%	0.59%
C.O.V. (%)	5.32	5.76	0.66
測定数	5	5	5
最小値	7.19 μm	9.47%	89.00%
最大値	8.19 μm	11.00%	90.50%
測定秒数	120 sec		

* コリメーターサイズ： $\phi 0.3\text{mm}$

■仕様・留意事項

- メーカー：
(株)フィッシャー・インストルメンツ
 - 型式：
FISCHERSCOP X-RAY XDV-SDD
 - 測定可能元素： Al (13)～U(92)
 - コリメーターサイズ (mm)：
 $\phi 0.1$, 0.3 , 1 , 3
 - ステージサイズ：
W370mm×D320mm
- * 測定には標準試料が必要です。特殊な測定の場合はご相談ください。

